

附件 1

貴重儀器設備管理人情形：

設備管理人	設備	減免方式(每台設備)	備註	依據(儀設委員會決議)
李伯軒教授	1. 金屬 3D 列印機(工 EV1012) 2. 雷射切割機(工 EV1013) 3. 線切割機(2 台-工 EV1013)(1 台-工 EN1028)	20 小時/每周	自 112 年 11 月起	112 學年度第 2 次
黃永茂教授	沖床(鍛壓機)(工 EV1011)	20 小時/每周	自 112 年 11 月起	112 學年度第 2 次
胡龍豪教授	表面粗度輪廓形狀量測儀(工 EN1027)	20 小時/每周	自 112 年 11 月起	112 學年度第 2 次
蔡尚南教授	線切割機(工 EN1028)	20 小時/每周	自 112 年 11 月起	112 學年度第 2 次
蔡尚南教授	熱機械分析儀(工 EV2020)	20 小時/每周	自 115 年 7 月起	114 學年度第 5 次
王郁仁教授	亞崙五軸 CNC 銑床(工 EN1027)	20 小時/每周	自 112 年 11 月起	112 學年度第 2 次
汪正祺教授	東台五軸 CNC 銑床(工 EN1027)	20 小時/每周	自 113 年 3 月起	112 學年度第 5 次
汪正祺教授	東台車銑複合機(工 EN1027)	20 小時/每周	自 113 年 5 月起	112 學年度第 6 次
李伯軒教授	掃描式電子顯微鏡(工二大樓頂樓)	20 小時/每周	自 113 年 6 月起	112 學年度第 7 次
蔡尚南教授	掃描式電子顯微鏡(工二大樓頂樓)	20 小時/每周	自 113 年 6 月起	112 學年度第 7 次
盧威廷教授	臥式 CNC 銑床(工 EV1011)	20 小時/每周	自 114 年 7 月起。	113 學年度第 3 次